

## 1. ラジカルモニター付きダイヤモンド成膜装置



### 【仕様】

#### プラズマCVD部:

- ・独立2系統反応チェンバ
- ・マイクロ波プラズマ発生部2系統
- ・トランスファー機構
- ・ロードロック機構
- ・チャンバー真空度  $10^{-5}$ Pa 以下

#### ラジカルモニター部:

- ・計測対象ラジカル H, C
- ・測定原理 原子吸収分光方式
- ・測定方式 プローブ挿入式

### 【特徴】

本装置は、ダイヤモンド基板上に高純度の単結晶ダイヤモンドを結晶成長させる成膜室と高純度の単結晶ダイヤモンドに高濃度の不純物をドーピングする成長室の2つの成膜室を有し、これらの成膜室に基板を搬送する搬送室を装備したマルチチャンバータイプのダイヤモンド成膜装置です。成膜室にはラジカルの状態を測定可能なラジカルモニターを装備します。

### 【使用例】

放電の様子

